

NUBIC知的財産情報開示

開示日： 2009年07月24日

各位

NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
尚、NUBICベンチャークラブ特別会員、一般会員にはすでにお知らせしています。

	NUBIC管理番号: <input type="text" value="2008000106"/>	整理番号 <input type="text" value="11372"/>	担当者 <input type="text" value="小森 幹雄"/>
表 題	<input type="text" value="LFプラズマジェット生成方法とLFプラズマジェット生成装置"/>		
技術分野	<input type="text" value="電気・電子"/>	<input type="text" value="機械・加工"/>	<input type="text"/>
適用製品	<input type="text" value="大気圧中での窒化材料生成や炭素系皮膜形成のためのプラズマ源"/>		
目 的	<input type="text" value="一般にヘリウムのみで放電可能とされたLFジェットを他のガスにも適用し、幅広い応用に適するプラズマ源を提供する。"/>		
技術概要	<input type="text" value="大気圧中で簡便にプラズマジェットを生成できるLFジェットはヘリウムを動作ガスとして液中殺菌、ナノ粒子合成、バイオマテリアル表面処理などに応用されてきたが、他のガスにおいては放電が安定せず、実用化はされていなかった。本発明では、新たな予備電離方法を開発することで、アルゴン等大気圧中で電離エネルギーの高いガスについてLFジェットの形成を可能とし、応用範囲を広げることに成功した。"/>		

技術移転等をご希望の場合は、下記事項をご記入の上、本用紙にてお申込みください。

(FAX, e-mail, 郵送いずれでも可。)

各担当コーディネーターからご連絡を差し上げます。

面談希望日時	<input type="text"/>		
(ふりがな) 氏 名	<input type="text"/>		
会社名	<input type="text"/>		
所 属	<input type="text"/>	役職	<input type="text"/>
電話番号	<input type="text"/>	FAX番号	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>		
連絡事項	<input type="text"/>		



【申込み・問い合わせ先】

日本大学産官学連携知財センター (NUBIC)

〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24 日本大学会館

TEL:03-5275-8139 FAX:03-5275-8328 E-mail:nubic@nihon-u.ac.jp